

3. 各种组件和仪器

1) 磁控靶



指标	靶尺寸: $\phi 2$ 英寸、 $\phi 4$ 英寸
	适用靶材: 磁性、非磁性、陶瓷材料
	电源: RF 射频和 DC 直流兼用
	形状: 直线型或靶头弯曲型(可调整角度)
	固定方式: 采用真空法兰和轴密封、任意位置固定
靶挡板: 手动或自动	

2) RF 射频电源、匹配器、控制器 (用于磁控溅射)



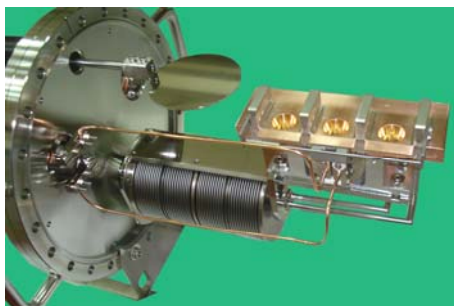
指标	1. 频率: 13.56MHz
	2. 功率: 50W~2000W
	3. 匹配器: 手调或自动
	4. 控制器: 手调或自动
有众多厂商品牌的产品可供选择	

3) DC 直流电源 (用于磁控溅射)



指标	1. 电压: 常用 800V (瞬时 1000V)
	2. 功率: 500W~3000W
	3. 控制: 电压/电流/功率 (可自由选择)
	4. 电弧: 瞬时检测及时灭弧
有众多厂商品牌的产品可供选择	

4) 电子枪(包括控制电源)



指标	1. 电子枪: 2KW 3 连 E 型, 适用于超高真空
	2. 坩埚容量: 1ml
	3. 固定法兰: ICF253
	4. 带挡板、电流端子、各种安全锁
	5. 控制电源: 220V 单相 15A
还有其它品牌的产品可供选择	

3 连电子枪和挡板固定在 ICF253 法兰上

5) 磁流体（旋转轴真空密封）

1 轴旋转



2 轴旋转

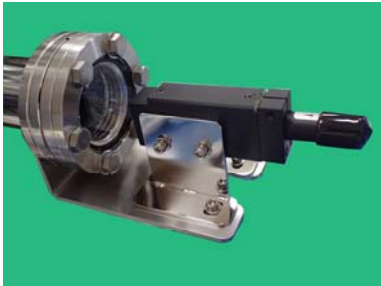


特点

- 1). 规则品或按客户要求定制
- 2). 品质高、价格合理

6) 红外测温仪

红外测温探头和夹具



变换器和温度表示器



指标与特点

- 1). 测温范围广 300~2000℃
- 2). 具有良好的精确度和再现性
- 3). 可安装在观察窗上随时监测样品等温度

7) 加热器控制器



特点

- 1). 可多频道控制
- 2). 小型设计
- 3). 可提供过热保护、温度显示及其它控制

8) 考夫曼离子源



指标与特点

- 1). KDC 考夫曼离子源: KDC10~160 五种机型
- 2). 控制电源: KSC1202, 1212 两种
- 3). 离子电流: 10mA~650mA,
- 4). 离子加速电压: 100~1200V
- 5). 主要用途: 基片清洗、改善镀膜质量、溅射

9) 各种蝶阀



指标与特点

- 1). 法兰: ICF70~305, NW(KF) 40~100, ISO 各种接口
- 2). 驱动形式: 手动, 气动和步进电机驱动
- 3). 适用范围: 调节排气量(可用于气压自动控制)和阀门开关
- 4). 特点: 法兰面间距离小, 性价比高

10) 红外高温加热器



指标与特点

- 1). 真空腔体外红外线加热灯
- 2). 加热温度: 1300°C (max)
- 3). 加热范围: 直接 ϕ 20mm
- 4). 升温速度: 100°C/sec
- 5). 冷却水: 2L/min
- 6). 电源: 100V 2000W

11) 各种品牌的真空计、泵、阀门和 MFC